

K 41514005 : สาขาวิชาฟิสิกส์

คำสำคัญ : โฟโต้ลูมิเนสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ / บ่อความตื้น / ชิลิกอนพรุน

อยุ่น กตัญญูพิศา : การสร้างโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์และการศึกษาลักษณะ
สมบัติทางแสงของบ่อความตื้นของแก้วเดี่ยมอาร์เชไนด์และชิลิกอนพรุน(THE CONSTRUCTION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTROMETER AND OPTICAL
CHARACTERIZATION OF GaAs QUANTUM WELL AND POROUS SILICON) อาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ประเสริฐ ไกรสิงห์เศชา. 118 หน้า. ISBN 974 – 653 – 189 – 1.

วิทยานิพนธ์ออกนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสร้างโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ส่วนหลังเป็นการศึกษาลักษณะสมบัติทางแสงของบ่อความตื้นและชิลิกอนพรุนโดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ ที่สร้างขึ้นในส่วนแรก สเปกโตรมิเตอร์ที่สร้างประกอบด้วย ชิ้นส่วนทางทัศนศาสตร์ เครื่องวัดแสงและอุปกรณ์ประมวลผลัญญาณ ทั้งระบบควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ที่ได้สามารถสอนเทียบกับสเปกโตร์มาตรฐาน โดยการศึกษานักวิทยาศาสตร์พบว่า โฟโต้ลูมิเนสเซนซ์สเปกตรัมที่ได้มี ตำแหน่งและรูปร่างใกล้เคียงกับสเปกตรัมที่ได้จากห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ใช้อุปกรณ์ที่ละเอียดกว่า

ผลการศึกษาชิลิกอนพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่อง粒粒และโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ พบร่วมกันที่มีผลต่อกล้องจุลทรรศน์ ความพรุนบนผิวหน้าและการเปล่งแสง ได้แก่ ความหนาและชนิดของแผ่นชิลิกอน เนื่องจากการกัด เช่น ระยะเวลา ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ความเข้มข้นของสารละลาย อิเล็กโทรไลท์

This thesis is composed of 2 parts, the first is the construction of photoluminescence spectrometer and the latter is the study of optical characterization of quantum well and porous silicon with the spectrometer. The spectrometer was constructed from optical parts, a detector and signal processing apparatus with a central controller via a microcomputer. It was calibrated with standard spectrometer by studying a quantum well sample and found that the photoluminescence spectra had both positions and shapes almost the same as those from standard laboratory which used a more precise spectrometer .

The results of study of porous silicon using a scanning electron microscope and photoluminescence spectrometer showed that the porosity and luminescence depended on thickness and type of silicon wafer, condition on anodization such as time, current density as well as concentration of electrolyte .